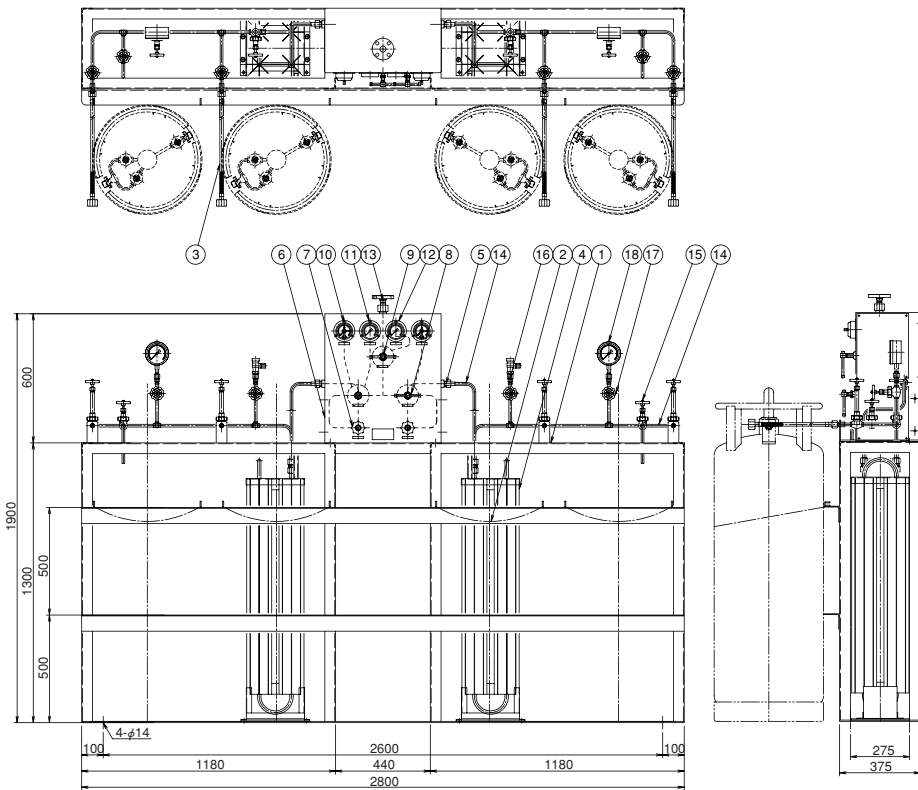


MCHP-140L (半自動切替式) / 全自動切替式

【架台セット 半自動切替装置 MCHP-140L型 LGC 2×2本立 (接点付)】

外観図



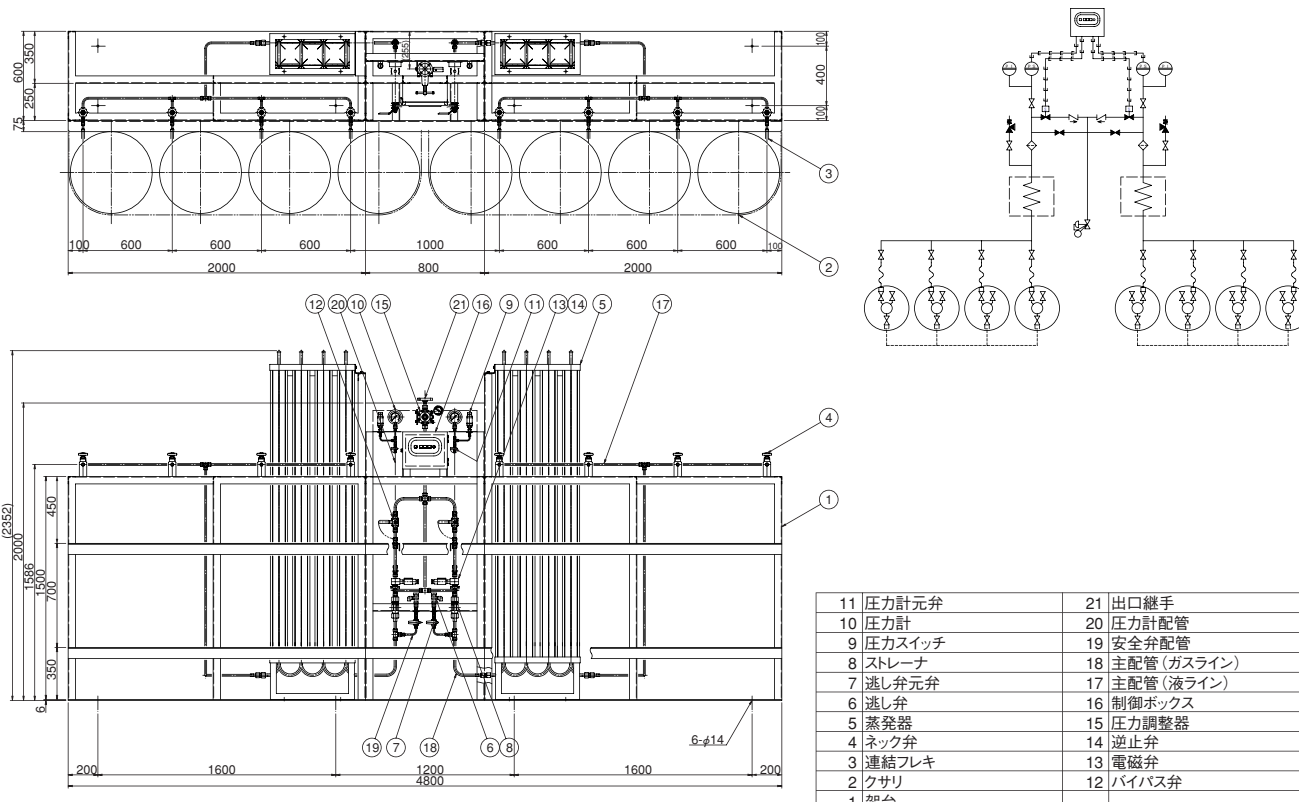
【設計仕様】

ガス名	フレキ~蒸発器	蒸発器 以降
	LN ₂	N ₂
ガスの種類	毒・燃・特殊以外	毒・燃・特殊以外
1 設計	2.5	
1 次 常用	1.3以上	
2 設計	—	0.99
2 次 常用	—	0.9
2 次 固定	—	0.99
2 次 可変	—	0.99
3 設計	—	0.9
3 次 常用	—	0.6~0.8
温度 °C	設計 -196~+40	-10~+40
温度 °C	常用 -196~+35	35
流量 m ³ /h (標準状態)	max.10	
容器接続継手	TW30山6	

10	1次圧力計 (下限接点付)	20	逃し弁
9	出口調整器	19	逃し弁元弁
8	切替調整器	18	圧力計
7	切替弁	17	圧力計元弁
6	ボックス	16	ネック弁
5	フィルター	15	ブロー弁
4	蒸発器	14	主管
3	フレキシブルチューブ	13	出口ジョイント
2	クサリ	12	3次圧力計
1	架台	11	2次圧力計

【架台セット 全自動切替装置 LGC 4×4本立製作例】

外観図



11	圧力計元弁	21	出口継手
10	圧力計	20	圧力計配管
9	圧カススイッチ	19	安全弁配管
8	ストレーナ	18	主管 (ガスライン)
7	逃し弁元弁	17	主管 (液ライン)
6	逃し弁	16	制御ボックス
5	蒸発器	15	圧力調整器
4	ネック弁	14	逆止弁
3	連結フレキ	13	電磁弁
2	クサリ	12	バイパス弁
1	架台		

I 一般工業ガス用 圧力調整器

II 分析用標準ガス・理科実験用 圧力調整器

III 半導体用特殊材料ガス・高純度・超高純度 キャリアガス用圧力調整器

IV 一般工業ガス 供給設備 機器

V 分析用標準ガス 供給設備 機器

VI 半導体用特殊材料ガス・高純度・超高純度 キャリアガス供給設備 機器

VII 大臣認定について

VIII 高圧ガスの法律

IX 参考資料